# 光学系统超分辨的光源编码技术\*

郭斌均 庄松林 (上海光学仪器研究所)

#### 提要

本文从 Wolf 的部分相干理论出发,提出了采用编码光源照明的新的光学像超分辨方法,并用实验证 实了这种方法的正确性。它克服了以往超分辨术的一些缺点,为超分辨的实用化研究展现了新的途径。 关键词: 超分辨,光学系统。

# 一、引 言

高分辨率一直是光学工作者所追求的目标。目前,传统的光学仪器已不能满足现代检 到的要求,所以,对超经典分辨极限(简称超分辨)的研究一直没有间断。于是,产生了一些 获得超分辨的方法。例如 Lukoz 的方法<sup>LD</sup>,这种方法利用两块完全相同的光栅,分别对物 面和谱面作两次衍射,使确定方向上的有效光瞳扩大近两倍;Gartner 和 Lohmann 方法则 是由 Wollaston 棱镜产生两束偏振方向互相垂直的斜光束照明物体,然后对叠合的两种偏 振态的物谱作重新安排,这样可使有效光瞳扩大约一倍。国内已有人利用这种方法制成了 叠频显微镜<sup>[20</sup>;此外,Blane 等人利用莫尔条纹方法,使用预调制和解调制两块光栅,亦使 有效光瞳扩大了一倍,不过这种方法得到的超分辨图像上叠合着余弦函数<sup>[30]</sup>.Freiden 则 是利用适当的光瞳滤波器来改变爱里斑的光强分布,从而提高通常意义下的分辨极限,这就 是人们所谓的变迹术。

以上所有的方法都有使用光栅或 Wollaston 棱镜进行预处理和解调两个过程。对物面 进行预处理的光栅,不可避免地要遮挡部分物体;在解调过程中,由于光栅或棱镜在成像系 统中引入了附加像差,使像质变差; Freiden 的变迹术因为增大了爱里斑中次极大光强,因 此,像质也较差。此外, Wollaston 棱镜主光轴之间,以及主光轴与入射光偏振方向之间必 须保证的精确角度关系很难调准。有鉴于此,以上的方法一直没有得到推广应用。

近代光学的研究已经表明,光的相干性对成像系统有重大影响<sup>[4,5,6]</sup>。本文建议一种采 用编码光源照明的超分辨方法,理论和实验证明了这种超分辨方法的有效性。因为物面和 像面之间没有增设任何元件,所以此方法可望成为一种实用的超分辨术而得到广泛的应用。

### 二、理论分析

<sup>▶</sup> 国家自然科学基金资助课题。

1, 假设物体是最一般的线对情况, 并设它们透光强度相等, 即:

$$O_{(s)} = \delta\left(x - \frac{l}{2}\right) + \delta\left(x + \frac{l}{2}\right), \qquad (1)$$

记物前表面上的相互强度为J<sub>1(m, m, \lambda)</sub>, 成像系统的脉冲响应函数 K<sub>(e, d', λ)</sub>。 这里λ 是准单色光照明的中心波长, l 是两 点的 间 距。如果 l 远远小于由光谱宽度决定的相干 长度, 那么, 由广义惠更斯原理知, 传播到像 面上的相互强度函数为





$$J_{4(\boldsymbol{x}_{1},\boldsymbol{x}_{1},\boldsymbol{\lambda})} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} J_{(\boldsymbol{x}_{1},\boldsymbol{x}_{2},\boldsymbol{\lambda})} \left[ \delta\left(x_{1} - \frac{l}{\lambda}\right) + \delta\left(x_{1} + \frac{l}{2}\right) \right]^{*} \left[ \delta\left(x_{2} - \frac{l}{2}\right) + \delta\left(x_{3} + \frac{l}{2}\right) \right] \times K_{(\boldsymbol{x}_{1},\boldsymbol{x}_{1},\boldsymbol{\lambda})}^{*} K_{(\boldsymbol{x}_{1},\boldsymbol{x}_{1},\boldsymbol{\lambda})} dx_{1} dx_{20}$$
(2)



Fig. 2 The principle of superresolution described in this paper

对于空间不变衍射系统

$$K_{(x_{1},x_{1},\lambda)} = \operatorname{sinc}\left[\frac{\Delta H(x_{1}'-x_{1})}{f\lambda}\right],$$

$$K_{(x_{1},x_{1},\lambda)} = \operatorname{sinc}\left[\frac{\Delta H(x_{1}'-x_{3})}{f\lambda}\right]_{0}$$
(3)

这里 a<sup>r</sup>为规化坐标,其值为实际坐标除以成像系统放 大率; 4H 是空间滤波器的尺寸,像面规格化强度分布 为:

$$\overline{I}_{(s')} = \operatorname{sinc}^{3} \left[ \frac{\Delta H\left(x' - \frac{l}{2}\right)}{f\lambda} \right] + \operatorname{sinc}^{3} \left[ \frac{\Delta H\left(x' + \frac{l}{2}\right)}{f\lambda} \right] + 2\operatorname{Re} \left[ \mu_{1} \left(\frac{l}{2}, -\frac{l}{2}\right) \right] \times \operatorname{sinc} \left[ \frac{\Delta H\left(x' - \frac{l}{2}\right)}{f\lambda} \right] \operatorname{sinc} \left[ \frac{\Delta H\left(x' + \frac{l}{2}\right)}{f\lambda} \right]_{s}$$
(4)  
$$\underline{X} \equiv \mu_{1} \left(\frac{l}{z}, -\frac{l}{z}\right) \neq \mathbb{R}$$
 (4)

-1或0就相当于相干或非相干成像情况。

in thus paper 我们知道,在图1那样一个 6f 系统中,物表面相 互强度函数是光源强度分布的准确的傅里叶变换,物面上相互强度只是两点间距的函数,面 与坐标无关。由于相互强度应为实偶函数,即 μ<sub>1(1)</sub>=μ<sub>1(-1)</sub>, (4)式可写成

$$\bar{I}_{(s')} = \operatorname{sinc}^{2} \left[ \frac{\Delta H\left(x' - \frac{l}{2}\right)}{f\lambda} \right] + \operatorname{sinc}^{2} \left[ \frac{\Delta H\left(x' + \frac{l}{2}\right)}{f\lambda} \right]$$

$$+2\mu_{1}(l)\operatorname{sine}\left[\frac{\Delta H\left(x'-\frac{l}{2}\right)}{f\lambda}\right]\cdot\operatorname{sine}\left[\frac{\Delta H\left(x'+\frac{l}{2}\right)}{f\lambda}\right]_{\circ}$$
(5)

图 2(a)示出了(5)式前两项的图形,它对应于两点的非相干成像,图中画的是瑞利分辨 极限时的情况。图 2(b)和(o)则示出了(5)式后一项的图形, (b)图对应于  $\mu_1(\frac{l}{2}, -\frac{l}{2})=1$ , (c) 图对应于  $\mu_1\left(\frac{l}{2}, -\frac{l}{2}\right) < 0$ 。附录给出了图 2(b)的证明, 图(d)示出了  $\mu_1\left(\frac{l}{2}, -\frac{l}{2}\right) < 0$ 时的像面上相对光强分布,和(a)图比,两 H(1) 点像的分辨情况得到了明显改善。因此.



Fig. 3 The relation between  $\mu(e)$  necessary for resolving and the distance of two points

物点间存在负的相干度是有利于提高分辨 率的。 当然, 两点像要实现由不可分辨到 可分辨,所需负相干度的数值是随两点间 距而不同的,按以下条件: (1) µ1(1) = µ1(-1);  $(2) \mu_{1(0)} \leq \mu_{1(l)}; \quad (3) \mu_{1(l)} = F_{(\gamma_{(m)})}; \quad (4) I_{(0)} /$ 

 $I_{(1/2)} \leq 0$ 。其中,  $\gamma_{(a_0)}$  为光源强度分布, 是 正实函数; o 是分辨常数, 对于瑞利极限 o=0.81。由此可以得到相干度所需满足的条件为

$$\mu_{1}\left(\frac{l}{2}, -\frac{l}{2}\right) \leq \frac{c + c \cdot \sin c \left[\frac{\Delta H \cdot l}{f\lambda}\right] - 2 \operatorname{sinc}^{2} \left[\frac{\Delta H \cdot l}{f\lambda}\right]}{2 \operatorname{sinc}^{2} \left[\frac{\Delta H \cdot l}{f\lambda}\right] - 2c \cdot \operatorname{sinc} \left[\frac{\Delta H \cdot l}{f\lambda}\right]} \,. \tag{6}$$

图 3 按不同的 c 值, 画出了满足分辨要求的规化相互强度函数曲线, 凡对应于某一间距处 线对的规化相互强度在曲线以下位置,则都是可以分辨的。

## 三、超分辨的实现及实验结果

从数学的角度来说,我们只要按图3所示满足(6)式的规化相互强度函数作一次逆傅里 叶变换,就得到了理想的超分辨编码光源强度函数,但必需满足光源 强度为非负实函数的要求。

如果照明系统如图 4 所示,由一个栅状发光面和透镜列阵组成, 又光栅状发光面的栅缝绝不出现在系统光轴上,并且关于光轴对称 分布,即发光面和透镜列阵的复透过率分别是

$$\gamma_{1(x_{0})} = \operatorname{reot}\left(\frac{x_{0}}{h}\right) * \operatorname{comb}\left(\frac{x_{0} - \frac{d}{2}}{d}\right), \tag{7}$$

$$\boldsymbol{\gamma}_{\boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{\beta})} = \left[ \operatorname{rect}\left(\frac{\boldsymbol{\beta}}{\boldsymbol{D}}\right) \cdot \exp\left(-\frac{ik\beta^2}{2f}\right) \right] * \operatorname{comb}\left(\frac{\boldsymbol{\beta}}{\boldsymbol{D}}\right)_{\circ} \qquad (8) \qquad \text{Fig. 4 Encodir source system}$$
则物面上的互相于度为

$$J_{\mathbf{1}(g_{1},g_{2})} = c \int_{-\infty}^{+\infty} \gamma_{\mathbf{1}(x_{0})} \cdot \gamma_{\mathbf{1}(x)}^{*} \cdot \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \gamma_{2(\beta)} \cdot \exp\left[\frac{i\pi(\beta - x_{0})^{2}}{d_{0}\lambda} + \frac{i\pi(x_{1} - \beta)^{2}}{d_{1}\lambda}\right] d\beta \right\}^{*} \\ \times \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \gamma_{2(\beta)} \cdot \exp\left[\frac{i\pi(\beta - x_{0})^{2}}{d_{0}\lambda} + \frac{i\pi(x_{2} - \beta)^{2}}{d_{1}\lambda}\right] d\beta \right\} dx, \tag{9}$$

Encoding

其中 h 是发光面栅缝的缝宽; d 是栅缝周期; D 是透镜列阵中各透镜口径; f 为 焦距; d 是 发光面与列阵面的间距; d1 是后者到物面的距离; c 是对后面讨论并非重要的常数。

经整理,原式成为

$$J_{1(a_{1},b_{1})} = c \sum_{l} \sum_{m} \sum_{n} \int_{q_{(l)}-\frac{h}{2}}^{a_{(l)}+\frac{h}{2}} \exp\left[\frac{\frac{b}{\partial \pi}c_{mn}}{\lambda}\right] \times \{ [C(b_{1n}^{1}) - C(b_{2n}^{1})] - \dot{y}[S(b_{1n}^{1}) - S(b_{2n}^{1})] \}^{\bullet} \\ \times \{ [C(b_{1m}^{1}) - C(b_{2m}^{1})] - \dot{y}[S(b_{1m}^{1}) - S(b_{2m}^{1})] \} dx_{o}$$
(10)

其中

$$\begin{cases} C_{(x)} = \int_{0}^{\pi} \cos \frac{\pi t^{2}}{2} dt, \ S_{(x)} = \int_{0}^{\pi} \sin \frac{\pi t^{2}}{2} dt, \\ a_{(1)} = x_{0} - \frac{d}{2} - \frac{ld}{2}, \\ b_{\pm m}^{*} = \sqrt{\frac{1}{d_{0}} + \frac{1}{d_{1}} - \frac{1}{f}} \left( mD \pm \frac{D}{2} + \frac{\frac{mD}{f} - \frac{x_{0}}{d_{0}} - \frac{x_{n}}{d_{1}}}{\frac{1}{d_{0}} + \frac{1}{d_{1}} - \frac{1}{f}} \right), \\ c_{mn} = \frac{D \cdot (m^{2} - n^{2})}{f} - \frac{x_{2}^{2} - x_{1}^{2}}{d_{1}} + \left[ \frac{2x_{0}(x_{2} - x_{1})}{d_{0}d_{1}} - \frac{D \cdot (m + n)(x_{2} - x_{1}) + D \cdot (m - n)(x_{2} - x_{1})}{d_{0}f} - \frac{2x_{0}D(m - n)}{d_{0}f} + \frac{D^{2}(m^{2} - n^{2})}{f^{2}} + \frac{x_{2}^{2} - x_{1}^{2}}{d_{1}^{2}} \right] / \left( \frac{1}{d_{0}} + \frac{1}{d_{1}} - \frac{1}{f} \right)_{0} \end{cases}$$

$$(11)$$

当  $d_0 = f$ , 并且 D = kd(k 是整数)时

$$J_{1(x_{1},x_{0})} = C' \sum_{l} \int_{\frac{a^{(l)} + \frac{h}{2}}{2}}^{\frac{h}{2}(l) + \frac{h}{2}} \exp\left[\frac{i2\pi x_{0}(x_{2} - x_{1})}{f}\right] \times \{[C^{(0\frac{1}{2})} - C^{(0\frac{1}{2})}] - \dot{y}[S^{(0\frac{1}{2})} - S^{(0\frac{1}{2})}]\}^{\bullet} \\ \times \{[C^{(0\frac{1}{2})} - C^{(0\frac{1}{2})}] - \dot{y}\{S^{(0\frac{1}{2})} - S^{(0\frac{1}{2})}]\} dx,$$
(12)

.....

其中

$$b_{\pm}^{n} = \frac{1}{\sqrt{d_{1}}} \left( \pm \frac{D}{2} - \frac{d_{1}x_{0} + fx_{n}}{f} \right)_{0}$$
(13)

若不考虑透镜口径对复可干度的影响,则规一化互相干度为

$$\mu_{1(l)} = \frac{\sin\left(\frac{N \, l d\pi}{f \lambda}\right)}{N \sin\left(\frac{l d\pi}{f \lambda}\right)} \cdot \operatorname{sinc}\left(\frac{h l}{f \lambda}\right),\tag{14}$$

N为发光缝数, $l = |x_2 - x_1|$ 。

上式表示一系列的窄脉冲,它们发生在

$$l = \pm n \frac{f\lambda}{d} \quad n = 0, \ 1, \ 2 \cdots$$
 (15)

当满足

$$l = \pm n \frac{f\lambda}{Nd} \quad n/N \neq \hat{\mathbf{E}} \hat{\mathbf{X}}$$
(16)

时,  $\mu_{1(l)} = 0_o$ 

由上两式可以知道,相干峰的间距与光栅常数成反比,各相干峰的宽度与整块光栅的尺



Fig. 5

(a) Light-intensity distribution of encoding source;
 (b) Mutual intensity distribution in object plane when a slit is at the axis of the system;
 (c) Mutual intensity distribution in object plane when slite are symmetrical about the axis, but no one at the axis

寸 Nd 成反比。由图 5(c)可见,前面讨论的情况能得到负值的相干峰,这是对实现超分辨非常有利的。

根据以上这些规律,只要按分辨的要求来决定负值相干峰的位置,并由此来选择光栅各 参量 d、h。

实验中,采用了栅状参数为d=1.8 mm、h=0.1 mm,辐射中心波长 $\lambda=5461$ Å的准单 色光源,以及焦距为f=3.9 mm、各小透镜口径D=3.6 mm 的透镜列阵。

实验在成像系统、观察系统和物面没有任何变化的情况下进行。图 6(a)是非相干照明 情况下的二号鉴别率板像,图上排自右至左是十六~十九组,读者或许可分辨到第十六组, 但要进一步分辨就困难了;图 6(b)则是采用栅状编码光源后的图像,除十六、十七、十八组 外,二十组以上几组都较清楚地得以分辨,不过光强很弱,在总结中我们将作出解释。因为 采用编码光源是按前面的讨论只考虑一维的超分辨,因此只须将注意力集中在各组的水平 线。



Fig. 6 Image of No. 2 resolution chart (a) Incoherent illumination; (b) Illumination with encoding source



Fig. 7 Image of integrated-circuit mask (a) Incoherent illumination; (b) Illumination with encoding source

图 7(a)是非相干照明时集成电路掩模板中某种间距约为 6 µm 结构的像,采用以上描述的光源后,分辨情况显著好转,如图 7(b)。理论计算的超分辨情况与实验结果符合得很好,所有这些证明了本文超分辨原理的正确性。

# 四、结 论

通过光源编码的方法,显著地提高了光学系统的分辨率,实现了通常意义下的超分辨。 它在提高分辨率的同时,不引入物成分的损失。对成像系统未曾进行变动,而仅改进了照明 方式,因此,这种超分辨方法在实用化方面是可能有用的。

我们采用图 4 所示的编码光源进行了实验,结果与理论计算的超分辨情况符合得很好, 这样就证明了本文的超分辨原理是正确的。 从图 2 知道,超分辨的像经历了一个相减的过程,与未实现超分辨的部分比光强会有减弱,并且随点对的间距和规格化相互强度的不同, 光强减弱的程度是不同的。也正因为这样,超分辨像的信噪比有所降低,因为背景噪声依然 如旧,这在图 6 和图 7 中能够看到。

前面我们看到,采用文中编码光源不能在一个非常宽广的区域满足(6)式;计算表明,超 分辨的像位置是偏离标准像点坐标 a'=1/2 的。所有这些都需要进一步的研究。

在实验中得到了陈蔚嘉和毛秀娟两同志的帮助,谨表感谢。

附 录

证图 2(b) 所示的情况,即证明:在区间 | x | <1/2 < c(c 待定),以下不等式一定成立:

$$\operatorname{sinc}^{2}\left[\frac{\Delta H \cdot \frac{l}{2}}{f\lambda}\right] \ge \operatorname{sinc}\left[\frac{\Delta H \cdot \left(x - \frac{l}{2}\right)}{f\lambda}\right] \cdot \operatorname{sinc}\left[\frac{\Delta H \cdot \left(x + \frac{l}{2}\right)}{f\lambda}\right],\tag{I}$$

并求c值。 证:记

$$\frac{f\lambda}{AH} = l^*,$$

那么(I)式变为

$$\operatorname{sinc}^{2}\left[\frac{l}{2l^{*}}\right] \ge \operatorname{sinc}\left[\left(x - \frac{l}{2}\right)l^{*}\right] \cdot \operatorname{sinc}\left(x + \frac{l}{2}\right)/l^{*}\right],\tag{III}$$

(II)

由对 sinc 函数的研究可以知道,在区间 $|x| < l^*$ , sin  $c\left(\frac{x}{l^*}\right)$ 是个单调的递减函数。因此当 $|x| < \frac{l}{2} < l^*$ 时,就必定有:

$$\operatorname{sinc}^{2}\left(\frac{x}{l^{*}}\right) \geq \operatorname{sinc}^{2}\left(\frac{l}{2 \cdot l^{*}}\right),$$

1 7.1)

990

$$rac{\sin^2(\pi x/l^*)}{(\pi x/l^*)^2} \! \gg \! rac{\sin^2(rac{1}{2.l^*})}{\left(rac{\pi l}{2l^*}
ight)^2}$$

利用倍角公式并移项后,得:

$$\frac{l^{2}}{4}[1-\cos(2\pi x/l^{*})]-x^{2}[1-\cos(\pi l/l^{*})] \ge 0,$$

亦即 
$$\frac{l^3}{4} [1 - \cos(\pi l/l^*)] + \frac{l^4}{4} [\cos(\pi l/l^*) - \cos(2\pi x/l^*)] - x^2 [1 - \cos(\pi l/l^*)] \ge 0,$$

$$\lim_{l \to \infty} \left( \frac{l^2}{4} - x^2 \right) \cdot \left[ 1 - \cos(\pi l/l^*) \right] \ge \frac{l^2}{4} \left[ \cos(2\pi x/l^*) - \cos(\pi l/l^*) \right]_{\bullet}$$

因为
$$|x| < \frac{l}{2}$$
,所以  $\frac{1 - \cos(\pi l/l^*)}{l^2/4} \ge \frac{\cos(2\pi x/l^*) - \cos(\pi l/l^*)}{l^2/4 - x^2}$ 

$$\frac{\sin^2\!\!\left(\frac{\pi l}{2l^{\star}}\right)}{l^2/4} \! \geq \! \frac{\sin\left[\frac{\pi}{l^{\star}}\!\left(x\!-\!\frac{l}{2}\right)\right]\!\cdot\!\sin\left[\frac{\pi}{l^{\star}}\!\left(x\!+\!\frac{l}{2}\right)\right]}{x^2\!-\!l^2/4}$$

从而有 
$$\frac{\sin^2\left(\frac{\pi l}{2l^*}\right)}{\left(\frac{\pi l}{2l^*}\right)} \ge \frac{\sin\left[\frac{\pi}{l^*}\left(x-\frac{l}{2}\right)\right] \cdot \sin\left[\frac{\pi}{l^*}\left(x+\frac{l}{2}\right)\right]}{\left[\frac{\pi}{l^*}\left(x-\frac{l}{2}\right)\right] \cdot \left[\frac{\pi}{l^*}\left(x+\frac{l}{2}\right)\right]},$$

即 
$$\operatorname{sinc}^2\left(\frac{l}{2l^*}\right) \ge \operatorname{sinc}\left[\left(x-\frac{l}{2}\right)/l^*\right] \cdot \operatorname{sinc}\left[\left(x+\frac{l}{2}\right)/l^*\right].$$
即在区间  $|x| < l/2 < l^*,$ 

即和

亦即

(I)式成立,也就是说,在1<21\*范围内,图2(b)所示情况是正确的,其中1\*如(II)式定义。

#### 羗 文献

- [1] S. H. Lee; «Optical Information Processing», (Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 1981), chap. 1.
- [2] 谭维翰,王润文; 《光学学报》, 1981, 1, No. 6 (Nov), 509~515。
- [3] 辻内顺平,村田和美;《光学信息处理》;(机械工业出版社,北京, 1983), chap. 3。
- [4] S. L. Zhuang, F. T. S. Yu; Appl. Opt., 1982, 21, No. 14(Jul), 2587~2593.
- [5] F. T. S. Yu, S. L. Zhuang et al.; Appl. Phys., 1982, B27, No. 1(Jan),99~104.
- [6] 庄松林,郑权;《物理学报》》,1985,5, No. 4 (Apr), 439~446。

#### Image superresolution with source encoding technique"

GUO BINJUN AND ZHUANG SONGLIN (Shanghai Institute of Optical Instruments)

(Received 27 September 1987; revised 1 February 1988)

#### Abstract

In this paper, a source encoding technique is presented for achiving superresolution image. The experimental demons-trations show that the superresolution can easily be obtained by using this new technique. The method overcomes several drawbacks of the others and shous a new approach for further study of practical applications of the superresolution technology.

Key words: superresolution; optical system.

<sup>\*</sup> Project supported by National Natural Science Foundation of China